



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211160953 U

(45)授权公告日 2020.08.04

(21)申请号 201921652646.2

(22)申请日 2019.09.30

(73)专利权人 无锡惠虹电子有限公司

地址 214000 江苏省无锡市新区硕放里河
20号

(72)发明人 钱涌 潘海旭 邓泽 陈守镇

(74)专利代理机构 北京国昊天诚知识产权代理
有限公司 11315

代理人 程爽

(51) Int. Cl.

B08B 3/04(2006.01)

B08B 13/00(2006.01)

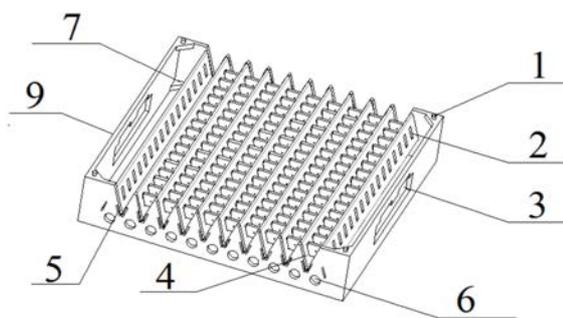
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于清洗陶瓷片的工装

(57)摘要

本实用新型提供一种便于清洗陶瓷片的工装,其涉及陶瓷产品超声清洗领域,旨在解决一般陶瓷片单片清洗工序复杂清洗效率低,清洗成本高,耗时长的问题。所述便于清洗陶瓷片的工装由两个完全相同的清洗框架上下拼接而成,所述清洗框架包括有框架、限位凹槽、限位凸起、清洗架,所述框架内部位于四个角处设有限位凹槽、所述框架面向工作人员的前后两侧设有清洗架卡槽以及排水孔,所述限位凸起位于框架内部的限位凹槽的上方,所述框架相对工作人员左右两侧设有把手孔。



1. 一种便于清洗陶瓷片的工装,所述便于清洗陶瓷片的工装由两个完全相同的清洗框架上下拼接而成,所述清洗框架包括有框架(9)、限位凹槽(7)、限位凸起(1)、清洗架(4),其特征在于,所述框架(9)内部位于四个角处设有限位凹槽(7),所述框架(9)面向工作人员的前后两侧设有清洗架卡槽(5)以及排水孔(6),所述限位凸起(1)位于框架(9)内部的限位凹槽(7)的上方,所述框架(9)相对工作人员左右两侧设有把手孔(3)。

2. 如权利要求1所述便于清洗陶瓷片的工装,其特征在于,所述清洗架(4)安装在清洗架卡槽(5)中,所述清洗架上设有陶瓷片卡孔(2)。

3. 如权利要求1所述便于清洗陶瓷片的工装,其特征在于,所述清洗架(4)倾斜安装在框架(9)中且安装好的清洗架(4)截面呈v型。

4. 如权利要求1所述便于清洗陶瓷片的工装,其特征在于,所述框架(9)位于相对限位凸起(1)的底部设有供限位凸起(1)安装的凹槽。

5. 如权利要求1所述便于清洗陶瓷片的工装,其特征在于,所述清洗框架拼接完成后为了便于操作设有清洗提篮(8)。

一种便于清洗陶瓷片的工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及陶瓷产品超声清洗领域,具体涉及一种便于清洗陶瓷片的工装。

背景技术

[0002] 现有技术中一般陶瓷片清洗方式为将陶瓷片放入不锈钢清洗篮内,存在多片堆叠问题,不利于清洗效率和清洗质量,同时产品互相接触容易产生破损。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种便于清洗陶瓷片的工装,以解决现有技术存在的一般陶瓷片单片清洗工序复杂清洗效率低,清洗成本高,耗时长的问题。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种便于清洗陶瓷片的工装,所述便于清洗陶瓷片的工装由两个完全相同的清洗框架上下拼接而成,所述清洗框架包括有框架、限位凹槽、限位凸起、清洗架,所述框架内部位于四个角处设有限位凹槽,所述框架面向工作人员的前后两侧设有清洗架卡槽以及排水孔,所述限位凸起位于框架内部的限位凹槽的上方,所述框架相对工作人员左右两侧设有把手孔。

[0005] 优选的,所述清洗架安装在清洗架卡槽中,所述清洗架上设有陶瓷片卡孔。

[0006] 优选的,所述清洗架倾斜安装在框架中且安装好的清洗架截面呈v型。

[0007] 优选的,所述框架位于相对限位凸起的底部设有供限位凸起安装的凹槽。

[0008] 优选的,所述清洗框架拼接完成后为了便于操作设有清洗提篮。

[0009] 本实用新型带来的有益效果:

[0010] (1) 本实用新型能够实现陶瓷片独立摆放避免碰撞,提高了陶瓷片的表面质量;

[0011] (2) 本实用新型结构简单造价便宜,简单易操作,提高了清洗效率。

附图说明

[0012] 图1是根据本实用新型便于清洗陶瓷片的工装单个清洗框架的结构示意图;

[0013] 图2是根据本实用新型便于清洗陶瓷片的工装安装好放入清洗提篮的整体图;

[0014] 图3是根据本实用新型便于清洗陶瓷片的工装拼接好的整体示意图;

[0015] 其中,1-限位凸起、2-陶瓷片卡孔、3-把手孔、4-清洗架、5-清洗架卡槽、6-排水孔、7-限位凹槽、8-清洗提篮、9-框架。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合具体实施例,对本实用新型作进一步地详细说明。

[0017] 如图1-3所示,本实用新型实施提供了一种便于清洗陶瓷片的工装,所述便于清洗陶瓷片的工装由两个完全相同的清洗框架上下拼接而成,所述清洗框架包括有框架9、限位凹槽7、限位凸起1、清洗架4,所述框架9内部位于四个角处设有限位凹槽7,用来限制清洗架

4在框架9内部的位置,所述框架9面向工作人员的前后两侧设有清洗架卡槽5以及排水孔6,用于排出清洗产生的水,所述限位凸起1位于框架9内部的限位凹槽7的上方,所述框架9相对工作人员左右两侧设有把手孔3,方便提升清洗框架。

[0018] 进一步来说,所述清洗架4安装在清洗架卡槽5中,所述清洗架4上设有陶瓷片卡孔2,方便安装需要清洗的陶瓷片。

[0019] 进一步来说,所述清洗架4倾斜安装在框架9中且安装好的清洗架4截面呈v型,使得安装陶瓷片由上往下越来越小限制陶瓷片的移动。

[0020] 进一步来说,所述框架9位于相对限位凸起1的底部设有供限位凸起1安装的凹槽,方便安装。

[0021] 进一步来说,所述清洗框架拼接完成后为了便于操作设有清洗提篮8,方便对已经安装好的清洗框架更好的操作。

[0022] 综上所述,本实用新型能够实现陶瓷片独立摆放避免碰撞,提高了陶瓷片的表面质量,结构简单造价便宜,简单易操作,提高了清洗效率。

[0023] 需要注意的是,本实用新型中使用的多种标准件均是可以从市场上得到的,非标件则是可以特别定制,本实用新型所采用的连接方式比如螺栓连接、焊接等也是机械领域中非常常见的手段,发明人在此不再赘述。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围。

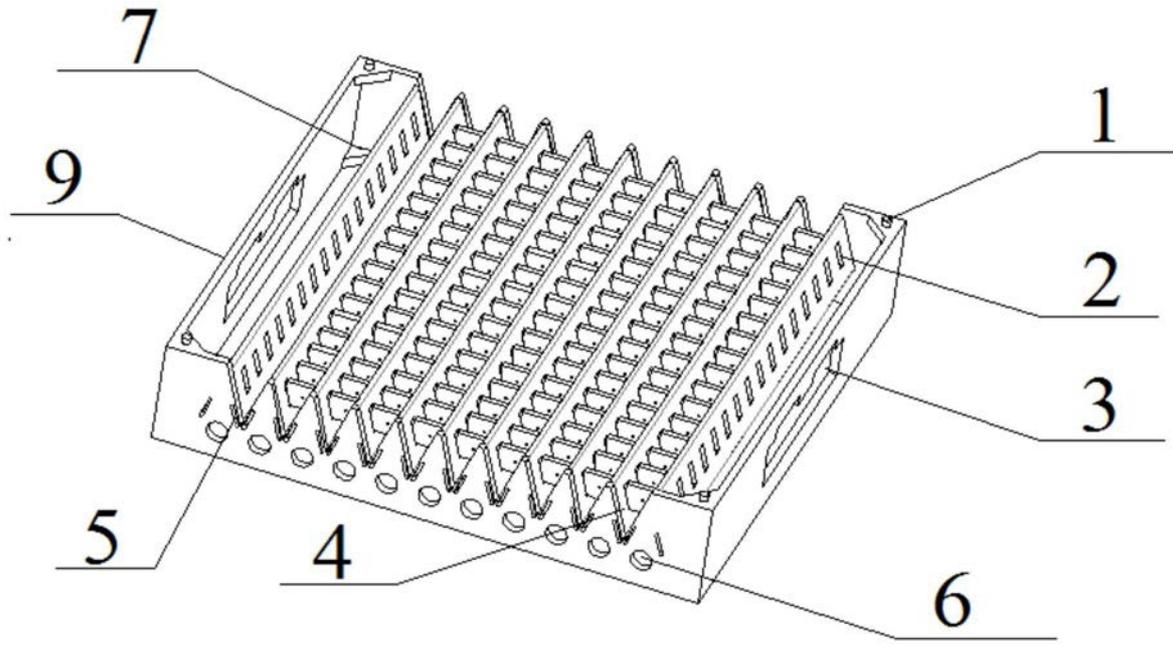


图1

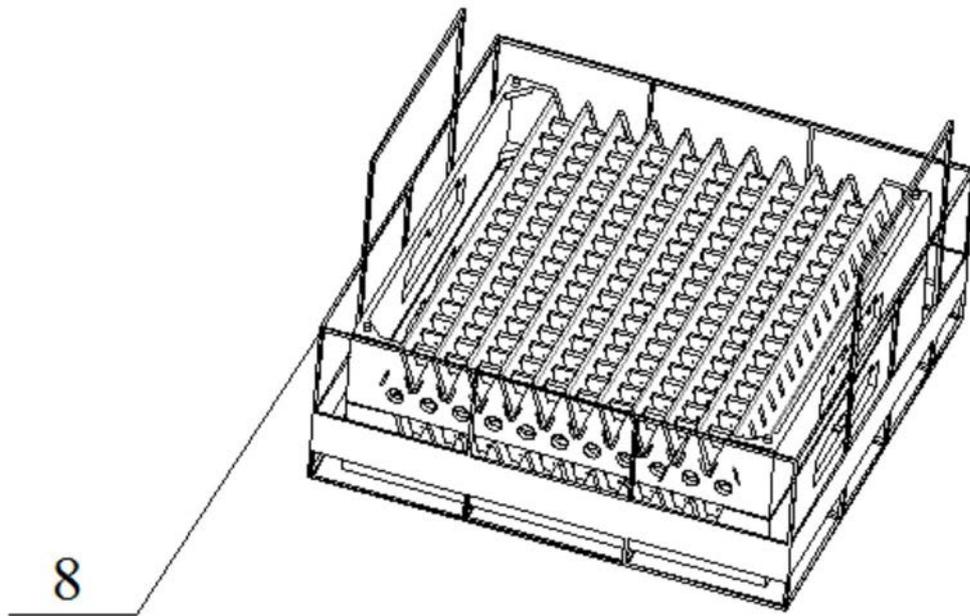


图2

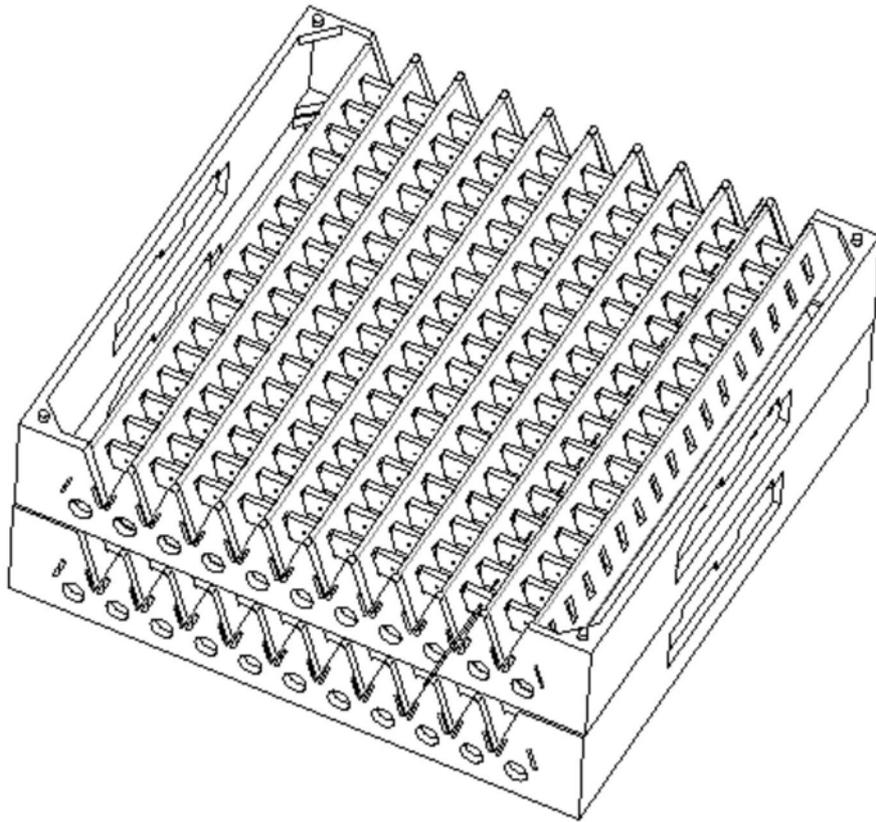


图3